

JAERI-Review 99-009

14. Bi-2212 への高エネルギーイオン照射によって導入された 欠陥構造のイオン種依存性

Ion species dependence of defect structures in high energy ion irradiated Bi-2212

佐々木優吉、黄達祥、幾原雄一<sup>\*</sup> 岡安悟、有賀武夫、北条喜一\*\* 財団法人 ファインセラミックスセンター 東京大学大学院工学研究科 日本原子力研究所\*\*

## 1. 緒言

酸化物超電導体への高い臨界電流密度特性の付与を目的として、種々の方法による磁束ピン止め点の導入が行われる。その一つの手段として、イオン 照射を用いた超電導体内への nm サイズの微細欠陥を導入する方法がある。 一方、磁束ピン止め効果は、導入された欠陥の構造と深く関与することが知られている。従って、イオン照射効果を理解するためには、導入された照射 欠陥構造を知る必要がある。通常、照射欠陥構造は、阻止能との関係で議論 される。本研究では、Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>x</sub>(Bi-2212)超電導単結晶を用いて、 Au と Fe を照射イオンとする高エネルギー照射を行い、導入された照射欠陥 構造と照射条件との関係について、透過型電子顕微鏡(TEM)を用いた直接 観察による検討を行った。その結果、イオン照射によって導入される欠陥構 造は、単に阻止能のみに依存するのではなくでなく、照射イオンの種類にも 依存することが分かった。

2. 実験

Bi-2212 単結晶(2×2×0.02mm)を用いて、原研タンデム加速器により 試料の<001>に沿って Au-230MeV または Fe-180MeV の照射を行った。 これら試料は、照射前後において SQUID を用いた測定を行い、磁気特性の 変化について評価した。また、照射試料の断面方向からの TEM 観察を行い、 照射イオンの飛程と照射欠陥構造との関係を検討した。さらに、 飛程に沿 った阻止能の計算を EDEP-1 コードを用いて計算し、照射欠陥構造と阻止能 の関係を調べた。

3. 結果と考察

Au および Fe イオンを用いて、おのおの照射密度 3.3×10 ions/cm<sup>2</sup> および 4.4×10 ions/cm<sup>2</sup> で照射した試料の照射前後の磁気特性を図1に示す。 不可逆磁場の値が、Au-230MeV 照射では約 40 倍、Fe-180MeV 照射では約 15 倍の特性の向上を示しており、磁束ピン止め点が導入されたことが確認される。この照射効果の違いは、照射密度ではなく主に生成した照射欠陥構造に依存するものであると推定される。

照射試料の磁束ピン止め点となる照射欠陥構造を知るために、TEM による 構造解析を行った。図 2 に Au-230MeV で照射した Bi-2212 試料の飛程に 沿って観察した照射欠陥構造の TEM 像を、また図 3 に Fe-180MeV で照射

した試料の観察結果を示す。Au-230MeV 照射によって形成された欠陥につ いては、昨年度の本研究会で報告したように、照射イオンの進入深に沿って カラムの太さが徐々に細くなり、それに伴って、楕円状のカスケード欠陥が カラム状欠陥に沿って生成すること、そしてさらに試料深部においては、タ ーゲット物質の電子励起によるカラム欠陥の生成は確認できなくなり、一列 に配列したカスケード欠陥のみが観察され、最終的にイオンが停止する領域 において、ランダムなカスケード欠陥の分布が観察される。この一連の構造 変化を図4に示す阻止能と進入深さとの関係と比較すると、阻止能(-dE/dx) の大きさの変化との対応によってよく説明される。また、カラム状欠陥が生 成する下限値も≒16keV/nm と、これまでに報告されている結果と一致し ている。一方、Fe-180MeV の照射欠陥のについては、表面から約 14 µm 程度の深さまで延びた長いカラム状欠陥が確認され、その最大カラム径は、 ほぼ均一で Au をイオン源とするカラム欠陥の最大カラム径よりも細い。こ の変化は、定性的には阻止能との関係で整理される(図 4)。即ち、Fe-180MeV 照射の場合、電子励起過程における阻止能(-dE/dx)が、Bethe のモデル の適用範囲から Firsov のモデルの適用範囲に移行する領域を含むため、阻 止能の値があまり変化しない領域が TEM 観察した範囲内に含まれる。図 4 の計算結果に現れたプラトーな領域がそれに対応するが、観察されたカラム 状欠陥の径が広い範囲にわたってほぼ一定となっており、計算結果と定性的 な一致を示している。また、カラム状欠陥の径が細いことも、阻止能の値と の関係で理解できる。

ただし、EDEP-1 の計算によると、Bi-2212 への Fe-180MeV の照射に おいては、阻止能の値が 16keV/nm を越えることがなく、最大でも 13keV/nm 程度である。この条件においてもカラム状欠陥は形成されてお り、イオン種に依存してカラム状欠陥の形成に必要な阻止能の最小値が異な ることが分かる。そのために、Fe-180MeV 照射においては、イオンの飛程 に沿ってかなり深い領域までカラム状欠陥が形成されている。Au-230MeV および Fe-180MeV の照射によって形成された照射欠陥の飛程に沿った変化 を図5に示す。

一方、Bi-2212の磁気特性に対する Au-230MeV 照射および Fe-180MeV 照射の違いは、図 1 に示すように 2~3 倍程度の違いが確認される。観察結 果からは、Fe-180MeV 照射によって形成されたカラム状欠陥の方がむしろ 欠陥の長さは長いが、Bi-2212 内のカラム状欠陥の磁束ピン止め効果に及ぼ す欠陥の径の影響が大ききことに依存した結果であると推定される。この結 果は、荻窪らによって示されたカラム状欠陥の直径と磁束ピンニング力密度 との関係に対応するものと考えられる。









図 2 Au-230MeV のイオン照射によってつくられた 照射欠陥の TEM 像

図 3 Fe-180MeV のイオン照射によってつくられた 照射欠陥の TEM 像







図 5 Au-230MeV と Fe-180MeV のイオン照射に よって形成された照射欠陥の模式図